

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第2部門第1区分
【発行日】平成25年8月1日(2013.8.1)

【公表番号】特表2010-532249(P2010-532249A)
【公表日】平成22年10月7日(2010.10.7)
【年通号数】公開・登録公報2010-040
【出願番号】特願2010-513760(P2010-513760)
【国際特許分類】

B 0 1 J 8/02 (2006.01)

【F I】

B 0 1 J 8/02 E

【誤訳訂正書】

【提出日】平成25年6月12日(2013.6.12)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

触媒プロセスのためのモジュール式反応装置パネル(1)であって、供給物ヘッド(5)、生成物ヘッド(7)および隣接する通路(3)を備え、

各通路(3)が、入口端から出口端まで延在する長さを有し、前記入口端が前記供給物ヘッド(5)に開いて直接接続されており、前記出口端が前記生成物ヘッド(7)に開いて直接接続されており、

前記供給物ヘッド(5)が、供給ライン(51)への接続部を少なくとも1つ有し、

前記生成物ヘッド(7)が、生成物ライン(55)への接続部を少なくとも1つ有し、

前記供給物ヘッド(5)と前記生成物ヘッド(7)の内の少なくとも一方が取り外しでき、前記通路の端へのアクセスができるようになっており、

前記供給物ヘッド(5)および前記生成物ヘッド(7)が前記通路(3)によってのみ保持されるように構成されている自立性モジュールであることを特徴とするパネル。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0099

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0099】

パネル29は、支持突起37を介して、反応装置45の筐体47の一部を構成する梁57、59の上に、固定されることなく、支えられている。この頂部での支持部分^{は別に}して、パネル29が反応装置内で自由に吊り下げられている。